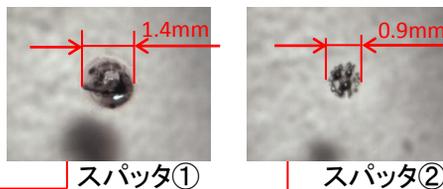


◆スキャナ加工ヘッドの保護ガラス汚れ検知

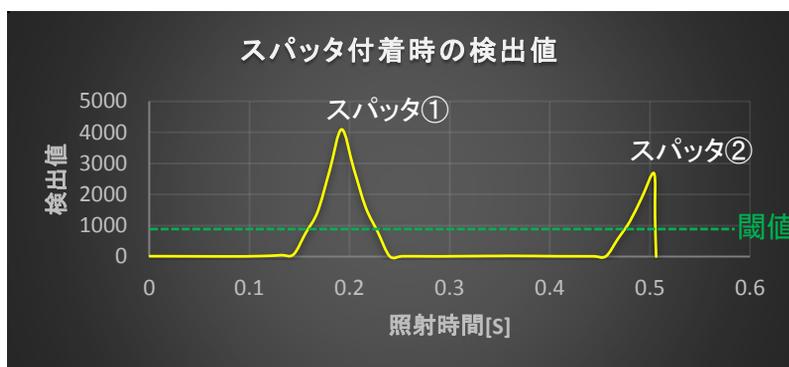
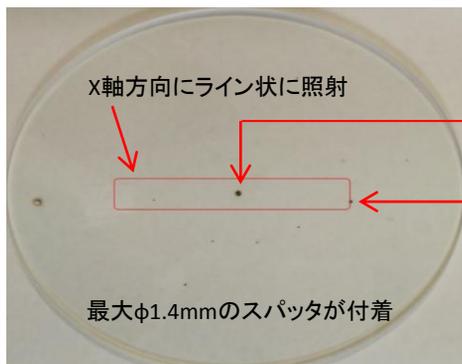
●スパッタ付着時の検出値

ピーク出力:1500W 照射時間:0.5s
 スパッタ付着のため使用したワーク:鉄材
 ※測定波形はワークを除いて照射したもの



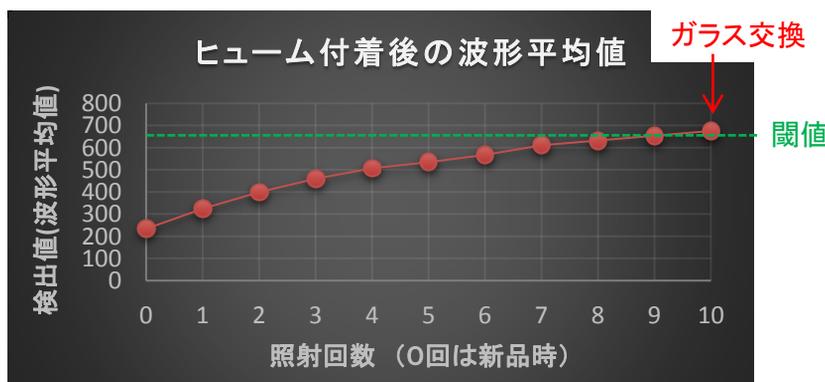
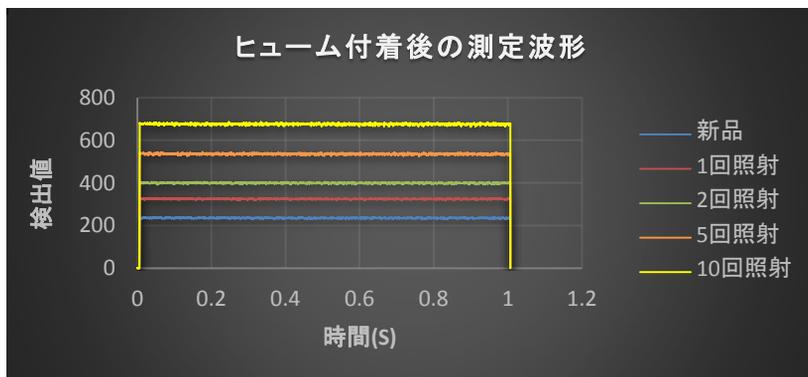
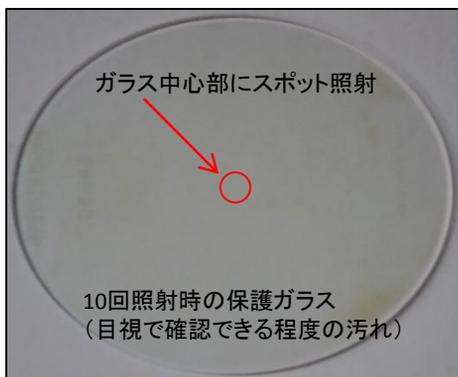
スパッタ①

スパッタ②



●ヒューム付着時の検出値

ピーク出力:1000W 照射時間:1s
 ヒューム付着のため使用したワーク:鉄材
 ※測定波形はワークを除いて照射したもの



NMI-300による保護ガラス汚れ検知

- ・スパッタにレーザー照射された箇所のみ数値が上昇するため、実際の照射領域の汚染状態を検知できる。
- ・ヒュームの蓄積度に応じて数値が上昇する。波形の平均値に任意の閾値を設けることで検知可能。既存のパワーメータでは検知できない微小な汚れ状態を検知することができる。